

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第3部門第2区分  
 【発行日】平成22年11月18日(2010.11.18)

【公表番号】特表2002-544250(P2002-544250A)  
 【公表日】平成14年12月24日(2002.12.24)  
 【出願番号】特願2000-618222(P2000-618222)

## 【国際特許分類】

C 0 7 C 67/055 (2006.01)  
 B 0 1 J 23/68 (2006.01)  
 B 0 1 J 37/04 (2006.01)  
 C 0 7 C 69/15 (2006.01)  
 C 0 7 B 61/00 (2006.01)

## 【F I】

C 0 7 C 67/055  
 B 0 1 J 23/68 Z  
 B 0 1 J 37/04 1 0 1  
 C 0 7 C 69/15  
 C 0 7 B 61/00 3 0 0

## 【誤訳訂正書】

【提出日】平成22年9月30日(2010.9.30)

## 【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0006

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0006】

実施例1：エチレンからのVAMの産出

第一触媒（触媒（a））： $MoV_{0.396}Nb_{0.128}Pd_xO_y$ （式中  $x = 1.90e - 0.4$  および  $y$  は共配置バランスに基づく）。

ステージI反応器に関する工程条件：286 / 200 psi

ステージII反応器に関する工程条件は参考文献、Chem System 91-10, Oct. 1992で記述したものと同様である。